

大塚電子Webセミナー

光を用いた各種分析装置を開発してきました大塚電子が、先端技術をサポートする分析装置と、その測定技術、応用例などについてのWebセミナーを開催いたします。

Seminar

15:00~16:00

2025
6/18
Wednesday

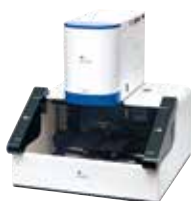
光干渉法を原理とする 膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ

光干渉式の膜厚計について、測定がうまくいかない、干渉が見えているのに膜厚がうまく出ない、そもそも測定がうまくいっているかわからない、ということはありませんでしょうか？

光干渉法の原理から測定例、よくある測定の質問、測定のコツなど光干渉法を原理とする膜厚測定装置をより良く使っていただく情報をご紹介します。

※本セミナーは2024年3月に放映したものを配信いたします。

関連機器



顕微分光を用いた微小領域での
絶対反射率測定により、高精度な膜厚・
光学定数解析が可能な装置

顕微分光膜厚計
OPTM series

お申込み方法

本セミナーは無料で参加できます。
下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/508>



ご視聴方法：本セミナーは、Microsoft Teams を使用します。

大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：岡本・真木

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3 丁目 26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町 1-6 橋完 LK ビル 2F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp